DI water 패스/ 아세톤 + 초음파 / IPA + 초음파

-> O2플라스마 (매뉴얼)

여기까지 Cleaning

Ion beam sputter +Ar 25W 4분(20나노) -> ITZO 증착

10분 안정화 (매뉴얼)

베이킹(Annealing)

300도 250도 200도 1시간씩

공통적인 것 – 안쓰는 상태의 기기는 항상 진공 유지

시작할 때 Vent부터

베이킹 후 각자에 ? 증착 (Thermal Everporating, 진공잡는데 3시간)